



Technische Fachhochschule Berlin  
University of Applied Sciences

# Amtliche Mitteilungen

---

23. Jahrgang, Nr. 33

Seite 1

2. Oktober 2002

---

## INHALT

Übergangsregelungen zur Studienordnung  
für den Studiengang ELEKTRONISCHE  
GERÄTETECHNIK UND MIKROSYSTEM-  
TECHNIK des Fachbereichs VII der Tech-  
nischen Fachhochschule Berlin  
(ÜStO VII EGM)

Seite 2

---

Herausgeber: Der Präsident der TFH Berlin; Presse- und Informationsstelle  
Lütticher Straße 37, 13353 Berlin  
Redaktion: Leiter der Studienverwaltung  
Druck: Copy-Center der TFH Berlin

**ÜBERGANGSREGELUNGEN ZUR STUDIENORDNUNG  
für den Studiengang ELEKTRONISCHE GERÄTETECHNIK UND  
MIKROSYSTEMTECHNIK  
des Fachbereichs VII der Technischen Fachhochschule Berlin  
(ÜStO VII EGM)**

vom 19.12. 2001

Gemäß § 71 Abs. 1, Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) in der Fassung vom 17.11.1999 (GVBl. S. 630), zuletzt geändert am 8.10.2001 (GVBl. S. 534), erlässt der Fachbereichsrat des Fachbereichs VII die folgende Neufassung der Übergangsregelungen zur Studienordnung für den Studiengang Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik.

### **§ 1 Geltungsbereich**

Diese Regelungen gelten für Studierende im Studiengang Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik. Sie löst die Übergangsregelungen zur Studienordnung für den Studiengang Feinwerktechnik und elektronische Gerätetechnik (§5 der Studienordnung StO 10EGM / §11 der Prüfungsordnung PrO 10 EGM in der Fassung vom 6.10.1997) ab.

### **§ 2 Grundsätze**

- (1) Nach Inkrafttreten dieser Regelungen läuft der Studienplan " Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik " aus. Er wird schrittweise, beginnend mit dem ersten Semester, durch den Studienplan "Mechatronik" ersetzt.
- (2) Studierende im Studiengang Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik führen ihr Studium nach dem Studienplan dieses Studienganges (Anlage 1 zur StO 10 EGM vom 22.9.1997 zu Ende.
- (3) Lehrveranstaltungen nach dem Studienplan " Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik " werden schrittweise dann nicht mehr angeboten, wenn der Studienplan "Mechatronik" nachrückt.

### **§ 3 Äquivalenzliste**

- (1) Für Lehrveranstaltungen nach dem Studienplan " Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik ", die nicht mehr angeboten werden, legt die Äquivalenzliste gemäß Anlage fest, welche Lehrveranstaltungen ersatzweise absolviert werden müssen, wenn eine mindestens "ausreichend" bzw. "mit Erfolg" lautende Lehrveranstaltungsnote noch nicht vorliegt.

### **§ 3 Äquivalenzliste**

- (2) Für Lehrveranstaltungen nach dem Studienplan " Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik ", die nicht mehr angeboten werden, legt die Äquivalenzliste gemäß Anlage fest, welche Lehrveranstaltungen ersatzweise absolviert werden müssen, wenn eine mindestens "ausreichend" bzw. "mit Erfolg" lautende Lehrveranstaltungsnote noch nicht vorliegt.
- (2) Weist die Äquivalenzliste eine Einzelfallregelung aus, so entscheidet der Dekan/die Dekanin im Benehmen mit einem Professor/einer Professorin, der/die für den Studiengang Mechatronik Mitglied der Ausbildungskommission ist. Dies gilt ebenso für alle nicht erfassten Fälle.

### **§ 4 Inkrafttreten**

Diese Regelungen treten am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der TFH Berlin in Kraft.

Anlage zu den ÜStO VII EGM vom tt. mm. 2001

**Äquivalenzliste****Grundstudium**

Lehrveranstaltung des Studiengangs Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik			Ersatzlehrveranstaltung des Studiengangs Mechatronik		
Studienfach	LV-Art	SWS	Studienfach	LV-Art	SWS
Programmieren	V	2	Softwaretechnik für die Mechatronik	V	2
	Ü	4		Ü	2
Bauelemente und Schaltungen der Elektronik I	V	4	Elektronik Grundlagen I	V	4
	Ü	2		Ü	2
Bauelemente und Schaltungen der Elektronik II	V	4	Elektronik Grundlagen II	V	2
	Ü	2		Ü	2
Werkstoffe I	V	4	Werkstoffe der Mechatronik I	V	4
Werkstoffe II	V	2	Werkstoffe der Mechatronik II	V	2
	Ü	2		Ü	2
Fertigungsverfahren I	V	4	Einführung Produktionstechnik	V	4
Fertigungsverfahren II	V	2	Formgebende Technologien	V	2
Fertigungsverfahren III	V	2	Einführung Mikrosystemtechnik	V	2
Fertigungsverfahren IV	V	4	Spezielle Produktionstechnologien	V	4
Fertigungsverfahren-Labor Grundlagen	Ü	1	Einzelfallregelung		
Getriebetechnik III	V	2	Einzelfallregelung		
Technische Optik	V	2	Optik Design	V	2
Konstruktionstechnik I	V	1	Einzelfallregelung		
Konstruktionstechnik II	V	3	Einzelfallregelung		
Konstruktionstechnik III	V	2	Einzelfallregelung		
Konstruktionstechnik IV	V	4	Einzelfallregelung		
Rechnergestützte Konstruktion I	Ü	2	Computer Aided Design I	Ü	2
Rechnergestützte Konstruktion II	Ü	4	Computer Aided Design II	Ü	4
Konstruktionstechnik-Übungen I	Ü	2	Einzelfallregelung		
Konstruktionstechnik-Übungen II	Ü	2	Einzelfallregelung		
Konstruktionstechnik-Übungen III	Ü	1	Einzelfallregelung		
Konstruktionstechnik-Übungen IV	Ü	2	Einzelfallregelung		
Wirtschaftliche Fertigung Grundlagen	V	4	Produkt-Controlling	V	4

Bedeutung der Abkürzungen:

LV-Art      Lehrveranstaltungsart  
V            Vorlesung

SWS            Semesterwochenstunden  
Ü                Übung

Anlage zu den ÜStO VII EGM vom tt. mm.2001

## Äquivalenzliste

### Hauptstudium

Lehrveranstaltung des Studiengangs Elektronische Gerätetechnik und Mikrosystemtechnik			Ersatzlehrveranstaltung des Studiengangs Mechatronik		
Studienfach	LV-Art	SWS	Studienfach	LV-Art	SWS
Betriebsablauf und Organisationsprobleme in Industriebetrieben	V	2	Produktionsmanagement	V	2
Elektrische Antriebe	V	4	Einzelfallregelung		
Arbeitsvorbereitung	V	4	Einzelfallregelung		
Steuerungstechnik	V	4	Einzelfallregelung		
Regelungstechnik	V	2	Einzelfallregelung		
Fertigungsverfahren – Labor (zwei Veranstaltungen aus dem gemeinsamen Wahlpflichtteil FVL)	Ü Ü	2 2	Produktionstechnik Labor (zwei Veranstaltungen aus dem gemeinsamen Wahlpflichtteil)	Ü Ü	2 2
Gerätekonstruktion	Ü	6	Einzelfallregelung		
Feingeräte A	V	2	Präzisionsgeräte I	V	2
Feingeräte B	V	2	Präzisionsgeräte II	V	2
Feingeräte-Labor A	Ü	2	Präzisionsgeräte Labor I	Ü	2
Feingeräte-Labor B	Ü	2	Präzisionsgeräte Labor II	Ü	2
Optische Geräte A	V	2	Optische Geräte I	V	2
Optische Geräte B	V	2	Optische Geräte II	V	2
Optische Geräte –Labor A	Ü	2	Optische Geräte –Labor I	Ü	2
Optische Geräte –Labor B	Ü	2	Optische Geräte –Labor II	Ü	2
Wirtschaftliche Fertigung	V	6	Einzelfallregelung		
Fertigungsmittelkonstruktion	V Ü	4 4	Mechatronische Fertigungssysteme	V Ü	4 4
Qualitätssicherung i.d. Mikrostrukturtechnik	V	2	Qualitätsmanagement	V	2
Fertigungsmesstechnik	Ü	4	Qualitätsmanagement Labor	Ü	4

Bedeutung der Abkürzungen:

LV-Art            Lehrveranstaltungsart  
V                Vorlesung

SWS  
Ü

Semesterwochenstunden  
Übung